

公 募 案 内

2022年5月6日

応募条件	募集職名	技術支援員 ・ 1名
	資格等条件	・勤務先で半導体プロセスの経験, あるいはプロセス装置の維持・管理の経験のある方 ・大学で2年以上の技術支援業務の経験があること. ・パソコンの基本操作とワード・エクセル他で自ら文書や表作成等ができる方 ・協調性があり, 几帳面で責任感のある方
	業務内容	・半導体プロセス装置 (マスクアライナー, 真空蒸着装置, など) の維持・管理 ・半導体プロセス装置の操作および操作の指導 ・薬品・半導体ガスの管理に関する業務 *詳細は, 下記担当までお問い合わせください。 氏名: 小山二三夫 E-mail:koyama@pi.titech.ac.jp TEL : 045-924-5068 FAX : 045-924-5068
	勤務予定地	横浜市緑区長津田町4259 科学技術創成研究院面発光レーザフォトンクス研究ユニット
	応募書類	①履歴書 (写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載) *応募書類は返却しません。*本学での勤務経験がある場合は, 所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。
	応募方法	封筒に「面発光レーザフォトンクス研究ユニット技術支援員応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送
採用試験	応募締切	2022年6月13日 (月) 必着
	選考方法	第1次 : 書類選考 第2次 : 面接試験
	試験日 内定通知	*第1次試験合格者のみ, 前日までに, 第2次選考の時間・場所等を通知します 最終選考の後, 10日以内に通知
待遇及び労働条件	雇用期間	2022年8月1日 ~ 2023年3月31日 ※更新の可能性有り (最長で 2025年6月30日まで) ※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ ただし, 本学有期雇用職員就業規則第7条, 第12条による
	給与	時間給 1,390円~1,680円 *通勤手当は本学の支給要件を満たす場合に支給 (本学有期雇用職員就業規則第56条による)
	勤務時間等	① 1週間の通常勤務時間 (休憩時間60分 例: 12:15~13:15) 月~金: 9:15~16:15 (6時間) ※週3日以上, 週18時間~30時間勤務。勤務曜日, 勤務時間については相談に応じます。 超過勤務: 有 (月平均6時間程度) ② 休日: 土曜, 日曜, 祝日, 年末年始 (12/29~1/3) ③ 有給休暇及びその他の休暇制度あり
	宿 舎	なし
	社会保険等	週20時間以上勤務の場合: 厚生年金, 健康保険, 雇用保険, 労働者災害補償保険 週19時間以下勤務の場合: 労働者災害補償保険
	雇 用 主 その他	国立大学法人東京工業大学長 敷地内禁煙 (ただし, 屋外指定箇所に喫煙所設置)
提出先	〒226-8503 横浜市緑区長津田町4259番地 S2-1 国立大学法人東京工業大学 学院等事務部 科学技術創成研究院業務推進課研究院事務第1グループ Tel: 045-924-5734, E-mail: iir.adm1@jim.titech.ac.jp	